

## ПРОБОЙ ГАЗОВОГО СЛОЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИЛЬНЫХ СВЧ ПОЛЯХ

А.В. Игнатьев, А.А. Рухадзе

УДК 533.537.5

*Показано, что при импульсном СВЧ пробое слоя газа в сильных полях плотность образованной плазмы может значительно превышать критическую, а функция распределения электронов близка к максвелловской с температурой ниже потенциала ионизации и имеет небольшой "горб" при энергиях порядка энергии их осцилляций в СВЧ поле.*

φ

1. В последние годы был проведен ряд теоретических и экспериментальных исследований /1-6/ по пробою газов в сильных СВЧ полях в условиях, когда энергия осцилляций электронов в поле волны намного превосходит энергию ионизации атомов газа, т.е.

$$W_0 = mv_0^2/2 = e^2 E_0^2/2m\omega_0^2 \gg I, \quad (1)$$

где  $E_0$  и  $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0$  – амплитуда и частота СВЧ поля,  $I$  – энергия ионизации атомов. Некоторые выводы теории /1-3/, качественно отличающейся от классической теории СВЧ пробоя газов в относительно слабых полях /7,8/, например, время развития пробоя, хорошо согласуются с экспериментальными данными /4-6/. Вместе с тем, ряд выводов теории, справедливой, строго говоря, только для пространственно однородного случая, находится в резком противоречии с экспериментом. Так согласно /1,3/, функция распределения электронов в плазме СВЧ пробоя газа в условиях (1) соответствует почти равнораспределению электронов по энергиям с некоторым пиком при энергиях порядка энергии их осцилляции в СВЧ поле, в то время как в экспериментах /4,5/ наблюдалось распределение Максвелла с температурой в несколько электронвольт (явно меньшей энергии ионизации атомов газа и, тем более, энергии осцилляции электронов в СВЧ поле). Кроме того теория /1-3/, также как и классическая теория СВЧ пробоя /7,8/, утверждает, что концентрация электронов  $n_e$  не может существенно превышать критическую  $n_c = m\omega_0^2/4\pi e^2$ , в то время как в экспериментах /4,5/ наблюдались концентрации  $n_e \gg n_c$ .

Устранению указанных противоречий между теорией и экспериментом и качественному объяснению наблюдаемых явлений посвящена настоящая работа.

2. Рассмотрим плоский слой газа толщиной  $\Delta < \lambda_0$  и давлением  $P_0$ , помещенный в сильное продольное СВЧ поле  $E = E_0 \sin \omega_0 t$ . Будем считать, что, наряду с неравенством (1), выполнены следующие условия \*)  
ловия \*)

$$P_0 \ll 3 \cdot 10^{-4} W_0^2 / \bar{z} l \Delta, \quad (2/z \lambda_0) \sqrt{W_0}, \quad (2)$$

где  $\bar{z}$  — среднее зарядовое число атомов газа. Первое из этих условий означает малость толщины слоя  $\Delta$  по сравнению с ионизационной длиной пробега электронов с энергией  $W_0$  в газе, т.е.  $\Delta < v_0 W_0 / 3 \nu_i l$ , где  $\nu_i \cong 10^8 \times X P_0 \bar{z} c / v_0$  частота ионизационных столкновений; второе же условие соответствует неравенству  $\omega_0 \gg \nu_i$ , которое обеспечивает справедливость (1) для  $W_0$ . Кроме того будем считать, что длительность импульса СВЧ меньше гидродинамического времени разлета плазменного слоя  $(\Delta / v_0)^{(m/M)^{1/2}}$ , где  $M$  — масса ионов, а поэтому в процессе пробоя газа слой остается неподвижным. Пусть слой плазмы, как это имеет место в экспериментах /4,5/, контактирует с проводящей поверхностью, так что быстрые электроны свободно могут покидать слой, не создавая потенциала.

Отметим, что при  $\bar{z} \sim 10$  (воздух),  $\Delta \sim \lambda_0 \sim 3 - 10$  см и  $W_0 \sim 1 - 10$  кэВ условия (3) хорошо выполняются вплоть до давления газа  $P_0 \leqslant 1$  торр, что также соответствует экспериментальным условиям /4,5/.

В указанных предположениях процесс пробоя газового слоя будет происходить следующим образом: сначала слой будет ионизоваться в поле СВЧ волны однородно, пока концентрация электронов не достигнет  $n_e^*$ , после чего СВЧ поле будет вытесняться на поверхность слоя с некоторой толщиной  $2\Delta^* < \Delta$ , не проникая во внутренние области; внутренние области газа будут продолжать ионизоваться потоками быстрых электронов, генерируемых СВЧ полем на поверхности слоя /3/. Концентрация электронов в узком поверхностном слое  $n_e^*$  определяется балансом ионизации газа в этом слое СВЧ полем, диффузионным притоком электронов из внутренних областей плазмы и потерями, обусловленным потоком быстрых электронов из слоя:

\*) Всюду ниже  $W_0$  и  $l$  даются в электронвольтах, длины  $\Delta$  и  $\lambda_0$  — в сантиметрах, а  $P_0$  — в торрах.

$$n_e^* \nu_i \delta = \frac{1}{3} n_e^* v_0 + D \frac{dn_e}{dx}, \quad (3)$$

где  $\delta = c/(4\pi e^2 n_e^*/m)^{1/2} < \Delta^*$  — толщина поверхностного слоя,  $D = v_{Te}^2/\nu_e$  — коэффициент диффузии плазменных электронов, концентрация которых  $n_e(x)$ , а температура  $T_e \sim \text{const}$ ,  $v_e \cong 3 \cdot 10^9 \text{ см/с}$ . Соотношение (3) следует рассматривать как граничное условие при  $|x| = \Delta^*$  к уравнению баланса для концентрации электронов во внутренней области плазмы, где СВЧ поле отсутствует и ионизация газа обусловлена потоком быстрых электронов из поверхностного слоя:

$$D \frac{d^2 n_e}{dx^2} + \nu_i n_e^* - \nu_a n_e - \beta n_e^2 = 0, \quad (4)$$

$$n_e \Big|_{|x| = \Delta^*} = n_e^*, \quad \frac{dn_e}{dx} \Big|_{x=0} = 0.$$

Здесь  $\nu_a$  — частота прилипания плазменных электронов, а  $\beta \approx 10^{-7}$  — константа рекомбинации /9/.

Пренебрегая прилипанием и рекомбинацией (при низких давлениях газа), из (4) находим распределение плотности электронов плазмы:

$$n_e = n_e^* + (\nu_i n_e^*/2D)[(\Delta^*)^2 - x^2]. \quad (5)$$

Подставляя это выражение в (3) и учитывая, что  $\delta \ll \Delta^*$ , имеем  $\Delta^* \approx \nu_0/3\nu_i$ , а

$$\frac{n_e(0)}{n_e^*} \cong 1 + \frac{W_0}{18T_e} \frac{\nu_e}{\nu_i}. \quad (6)$$

Наконец отметим, что, так как при ионизации газа быстрыми электронами образуется плазма со средней энергией электронов порядка энергии ионизации атомов, то и температура плазмы  $T_e < I$ . Поэтому функция распределения электронов в слое должна быть близкой к максвелловской с  $T_e \leqslant I$ , на которой, однако, имеется "горб" быстрых электронов с концентрацией  $n_e^*$  и энергией  $W \sim W_0$ . Концентрация  $n_e^*$  определяет и поток быстрых электронов, покидающих слой.

3. В заключение проведем численные оценки для СВЧ пробоя воздуха, соответствующие условиям эксперимента /5/. При  $z \sim 10$ ,  $W_0 \sim 1 \text{ кэВ}$ ,  $T_e \sim 3 \text{ эВ}$  и  $\Delta \sim \lambda_0 \sim 10 \text{ см}$  согласно (6)  $n_e/n_e^* \sim 10^2$ , а толщина плазменного слоя  $2\Delta^* \sim 1 \text{ см}$ . В экспериментах /5/ действительно наблюдались концент-

рации электронов, намного больше критической, а число быстрых электронов составляло около 1% от их общего числа.

Хотя выше мы говорили об изолированном газовом слое с  $\Delta < \lambda_0$ , не трудно понять, что все полученные выше результаты справедливы для случая, когда происходит пробой газа на поверхности твердого тела. В этом случае быстрые электроны будут генерироваться в слое толщиной  $\delta$  и поддерживать плазму на поверхности твердого тела с толщиной  $\Delta^*$ . Поэтому приведенные выше оценки сохраняются с учетом того обстоятельства, что пробой будет происходить в парах материала твердого тела.

Поступила в редакцию 29 ноября 1983 г.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. С.Г. Арутюнян, А.А. Рухадзе, Краткие сообщения по физике ФИАН, № 9, 12 (1978); Физика плазмы, 5, 702 (1978).
2. С.Г. Арутюнян, А.В. Игнатьев, А.А. Рухадзе, Краткие сообщения по физике ФИАН, № 7, 17 (1979).
3. А.В. Игнатьев, А.А. Рухадзе, Физика плазмы, 9, 1198 (1983).
4. В.И. Баринов и др., Труды ФИАН СССР, "Наука", М., 92, 35, 1974 г.
5. В.И. Баринов, Д.М. Карфидов, Физика плазмы, 1, 638 (1975).
6. S.G. Arutyunyan et al., Journ. Physique, 40, Suppl. 7, p. C-7-219 (1979).
7. А. Мак-Дональд, СВЧ-пробой газов, "Мир", М., 1969 г.
8. Ю.П. Райзер, Лазерная искра и распространение разрядов, "Наука", М., 1974 г.
9. И. Мак-Даниель, Процессы столкновений в ионизованных газах, "Мир", М., 1967 г.